

小型でローコストのマスフローメーター・コントローラー

**BASIS**TM

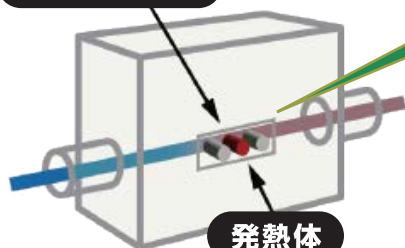
Small Flow Controllers and Meters

設置スペースが取りにくい場所にも
無駄のない接続配置ができるコンパクト設計。RS-485
標準搭載PLCなどによる
一括監視が可能**MEMSセンサーを使用したスピーディーな計測が可能。**

高精度のMEMSセンサーで、誤差が少なくスピーディーな計測ができます。

BASISに内蔵されている **MEMSセンサー**

温度センサー



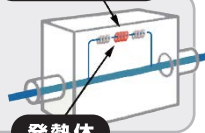
発熱体

バイパスが不要！直接流れるガスの温度を測るので
正確な温度の読み取りが速くなります。

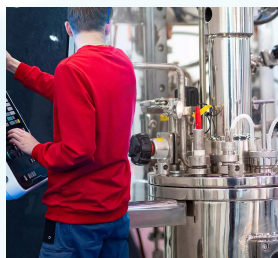
▶ 従来の熱式流量計について

バイパス部分を使って温度を測るので温度の読み取りが遅くなります。

温度センサー



発熱体

特徴 1**広範囲での
流量制御が可能**

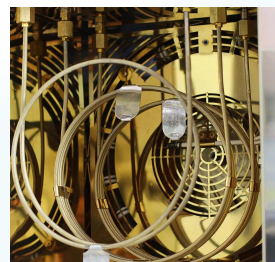
1台で広い範囲が計測でき、使用台数を抑えコスト削減が可能です。対応ガスは空気を含め8種類です。流量変化にすばやく追従し、高精度かつ安定した流量制御を行います。

特徴 2**バーナー制御
アプリケーション**

ガラスを加熱して加工するバーナー制御アプリケーションなどに使用されます。BASISを使用し、ガスを制御することで正確にコントロールできます。ラボ品質での厳しい基準に対応することができます。

特徴 3**混合ガスを
生成可能**

正確な流量コントロールにより、混合ガスの生成ができます。あらかじめ設定しておくことにより、正確な比率で混合ガスが生成ができます。

特徴 4**正確な
化合物検出**

BASISを使用してキャリアガス流量を精度良く測定出来るため、ガスクロマトグラフィーで正確に化合物を検出することが出来ます。

BASIS™

マスフローメーター・コントローラー

各気体ごとの流量精度	
Air・N ₂ ・O ₂ ・CH ₄	±1.5% RD / ±0.2% F.S.
He・H ₂	±1.8% F.S.
Ar	±1.5% RD / ±0.5% F.S.
CO ₂ ・N ₂ O	100 SCCM – 2 SLPM ▶ ±1.5% RD / ±0.5% F.S. 5 SLPM – 20 SLPM ▶ ±2.0% RD / ±1.0% F.S. 50 SLPM – 100 SLPM ▶

仕様	
繰り返し性 (2σ)	±0.25% RD / ±0.05% F.S.
流量範囲	0.1% ~ 100% F.S. (1000:1)
ゼロシフト / スパンシフト	0.05% RD / °C
動作温度	0 ~ 50°C
温度精度	±1.5°C
センサー応答速度	100ms
ウォームアップ時間	1 分
適合ガス	Air・N ₂ ・O ₂ ・CH ₄ ・He・H ₂ ・Ar・CO ₂ ・N ₂ O



- ・PD 制御により短時間で目標流量へ到達。流量変化にすばやく追従し、安定した流量制御。
- ・ウォームアップ時間は 1 分。すぐの稼動が可能です。
- ・0-5VDC 入力による制御流量の設定が可能です。
- ・現在流量を 0-5VDC で出力。ロガーなどによる記録ができます。

機械仕様

最大範囲	寸法 (mm)	重量 (g)
100 SCCM – 2 SLPM	H39.4 × W68.60 × D22.23	116 g
5 SLPM – 20 SLPM	H46.5 × W84.00 × D25.40	171g
50 SLPM – 100 SLPM	H52.3 × W114.8 × D35.00	355g



※改良のため仕様、および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



日本スターテクノ株式会社

Japan Star Techno Co., Ltd.

東京本社 〒302-0004 茨城県取手市取手3-4-20 中山ビル202
TEL.0297-86-6688 / FAX.0297-86-6684大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-1-6 本町カノヤビル501
TEL.06-4397-4571 / FAX.06-4397-4612